



## 新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流

现在位置：首页 &gt; 新闻动态 &gt; 综合新闻

## 微电子所“多场驱动键合系统研制”项目通过验收

2012-02-06 | 编辑：八室 李楠 | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

1月16日，中科院计划财务局组织专家到微电子研究所对微电子设备技术研究室（八室）承担的院装备项目“多场驱动键合系统研制”进行了验收。经检查，该项目完成了任务指标要求，经费使用合理，验收材料齐全，专家组一致同意通过验收。

多场驱动键合系统采用多场耦合驱动方式（电场、温度场、压力场），具有独特的紫石英压力分布调整结构，可完成阳极键合、黏着键合、共晶键合等多种工艺。与现有键合设备的刚性压力结构相比，该装置对压头之间非平面性、各种厚度和异质薄膜材料的适应性更强，避免键合过程中的材料破损，提高键合的均匀性和成品率。该系统的研制为国家发展具有自主知识产权的下一代IC关键装备进行了技术储备。

验收专家组听取了项目组的研制报告、使用报告、财务报告及测试专家组的现场测试报告并在现场检查了设备运行情况，一致认为该系统为国内首次研制的自主知识产权的多场驱动键合系统，其独特的自适应压力分布调整结构具有创新性，并且已成功应用于气密性封装、LED键合封装等研究，并创新性地实现了一种全新的大尺寸高质量石墨烯的宏量制备方法，具有重要的科学意义和实用价值。



设备图片



报告会



专家组在现场检查设备

项目组联系方式：

项目负责人：李超波

邮 箱：[lichaobo@ime.ac.cn](mailto:lichaobo@ime.ac.cn)

研究室网页：<http://www.ime.cas.cn/jgsz/kybm/wdzbjsyjs/yjsjj/>

附件下载：



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编：100029

单位地址：北京市朝阳区北土城西路3号，电子邮件：[webadmin@ime.ac.cn](mailto:webadmin@ime.ac.cn)

京公网安备110402500036号